

発明の名称	多孔質半導体膜の形成方法、発光素子、及び光学センサ(特許第 4257431 号)	
学内発明者	安達 定雄(元理工学府) 他	
技術分野	発光素子、光学センサ	IP16-033
発明の概要	可視から紫外で発光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成する多孔質半導体膜の形成方法を提供する。多孔質半導体膜の形成された半導体基板を用いて、可視から紫外で発光が可能な発光素子及びセンサを提供する。	
説明図		本発明の実施例に係る発光素子の発光スペクトルを示す線図
ポイント	可視から紫外で発光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成することができる。また、本発明の方法で多孔質半導体膜が形成された半導体基板を用いて、可視から紫外で発光が可能な発光素子及びセンサを提供することができる。	

発明の名称	多孔質シリコン膜及びその製造方法並びに半導体発光素子(特許第 4392505 号)	
学内発明者	安達 定雄(元理工学府)	
技術分野	電子デバイス	IP17-075
発明の概要	膜厚の均一な多孔質シリコン膜から、高い発光効率での可視発光が可能な半導体発光素子を簡便かつ再現性よく製造することができる。	
説明図		多孔質シリコン膜のPL強度を示すグラフである。
ポイント	可視発光が可能で膜厚の均一な多孔質シリコン膜とこの多孔質シリコン膜を簡便かつ再現性よく製造する製造方法とを提供する。また、この多孔質シリコン膜を用いた高発光効率の半導体発光素子を提供する。	